

тельствует о меньшей величине  $a_M$  в германии с РД. Вид температурных кривых удельного сопротивления для германия с РД свидетельствует о том, что энергия активации проводимости исчезает при  $N_{PD} \approx 4 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ . К сходным выводам приводят также данные работы [4], представленные на рис. 1. Таким образом, можно заключить, что боровский радиус при переходе Мотта ( $a_M \approx 30 \text{ \AA}$  для германия с РД) существенно меньше, чем боровский радиус, обеспечивающий прыжковую проводимость ( $a = 40 \text{ \AA}$ ).

На рис. 2 приведены зависимости величины боровского радиуса от среднего расстояния между примесями для германия с РД, германия, легированного Ga [6] и InSb [6]. Отметим, что сопоставление этих кривых указывает на значительно меньшую зависимость боровского радиуса от расстояния между примесями в германии с РД по сравнению с германием, легированным галлием, причем величина боровского радиуса оказывается ближе к расчетной, получаемой с использованием эффективной массы тяжелых дырок.

### Список литературы

- [1] Доброго В. П., Ермолаев О. П. // ФТП. 1976. Т. 10. В. 5. С. 999—1001.
- [2] Dobrego V. P., Ermolaev O. P., Tkachev V. D. // Phys. St. Sol. (a). 1977. V. 44. № 2. Р. 435—442.
- [3] Мотт Н. Ф. Переходы металл—изолят. М., 1979. 342 с.
- [4] Кожух М. Л., Липкина Н. С., Шлиман И. С. // ФТП. 1985. Т. 19. В. 2. С. 331—336.
- [5] Chroboczek J. A. // Proc. XI Conf. «Physics of Semiconducting Compounds». Jaszowice, Poland, 1981. V. 4. Р. 69—80. Fritzche H. // J. Phys. Chem. Sol. 1958. V. 6. Р. 68—80.
- [6] Гершензон Е. М., Куриленко И. Н., Литвак-Горская Л. Б. // ФТП. 1974. Т. 8. В. 6. С. 1186—1190.

Белорусский  
государственный университет  
им. В. И. Ленина  
Минск

Получено 28.04.1989  
Принято к печати 11.08.1989

ФТП, том 24, вып. 3, 1990

## ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ УРОВНЯ ФЕРМИ В АМОРФНОМ ГИДРИРОВАННОМ КРЕМНИИ *n*-ТИПА

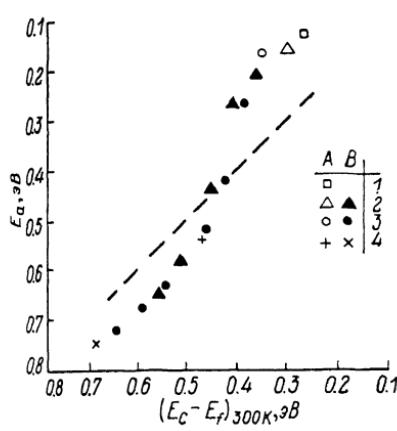
Казанский А. Г.<sup>1</sup>

Как известно, в нелегированном и легированном донорами аморфном гидрированном кремнии ( $a\text{-Si : H}$ ) температурная зависимость проводимости определяется выражением  $\sigma = \sigma_0 \exp [-(E_c - E_f)/kT]$ , где  $E_f$  — положение уровня Ферми, а  $E_c$  — положение края зоны проводимости, вблизи которого происходит движение носителей заряда [1]. В предположении линейной температурной зависимости положения уровня Ферми относительно края зоны проводимости можно записать  $(E_c - E_f)_T = E_a - \gamma T$ , где значения  $E_a$  и  $\gamma$ , вообще говоря, зависят от области температур, в которой проводится линейная экстраполяция, причем величина  $\gamma$  определяется температурным изменением положения  $E_f$  и  $E_c$  [1]. В этом случае  $\sigma = \sigma_0 \exp (\gamma/k) \exp (-E_a/kT)$ . В ряде работ, посвященных исследованию  $a\text{-Si : H}$ , величина  $E_a$  используется для получения информации о положении уровня Ферми. При этом изменение  $E_a$ , происходящее при различных воздействиях на  $a\text{-Si : H}$  (легирование, облучение светом), непосредственно связывают с изменением положения  $E_f$  [2—4]. В то же время температурная з

<sup>1</sup> Работа выполнена в Марбургском университете.

вспомогательной  $E_f$ , определяется статистическим сдвигом уровня Ферми [5]. Соответственно отличие  $E_a$  от  $(E_c - E_f)$  при данной температуре определяется формой плотности состояний в области энергий, в которой происходит температурное смещение  $E_f$ .

В настоящей работе проведены сравнительные измерения величины  $E_a$  в области комнатных температур и положения  $E_f$  относительно  $E_c$  для образцов  $a\text{-Si : H}$   $n$ -типа с различным уровнем легирования. Положение уровня Ферми определялось из измеренных значений темновой проводимости [6, 7]. При расчетах использовалось значение  $\sigma_0 = 150 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ , которое, согласно [7], наиболее вероятно для  $a\text{-Si : H}$ .



Данные соответствуют образцам 1, 2, 3, 4, полученным при относительной концентрации фосфина в газовой смеси с силаном  $10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7}$ . Представлены результаты для образцов в отожженном состоянии (A) и после их освещения в течение различного времени (B).

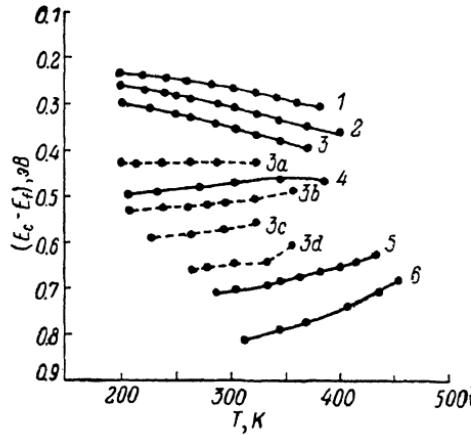


Рис. 2. Температурные зависимости положения уровня Ферми относительно зоны проводимости ( $E_c - E_f$ ) для легированных (1-4) и нелегированных (5, 6) образцов  $a\text{-Si : H}$ .  $3a, 3b, 3c, 3d$  соответствуют образцу 3 после его освещения в течение 1, 2, 15 и 960 мин.

В работе исследовались легированные образцы  $a\text{-Si : H}$ , полученные разложением моносилана в ВЧ тлеющем разряде при температуре подложки  $T_s = 250$  К. Легирование осуществлялось введением фосфина в реакционную камеру. Относительная концентрация фосфина в газовой смеси с силаном ( $[\text{PH}_3]/[\text{SH}_4]$ ) изменялась от  $10^{-7}$  до  $10^{-4}$ . Перед измерениями образцы отжигались в вакууме в течение 30 мин при температуре 180 °C. Измерения проводились как для отожженных образцов, так и после их освещения светом лампы накаливания через тепловой фильтр с интенсивностью 50 мВ/см<sup>2</sup>. Облучение позволяло изменять для данного образца величину проводимости и энергию активации ее температурной зависимости [8].

На рис. 1 показана корреляция величины  $E_a$ , измеренной в области комнатных температур, и положения уровня Ферми относительно зоны проводимости при  $T = 300$  К. Представлены данные как для отожженных образцов, так и после их освещения в течение различного времени. Как видно из рисунка, значение  $E_a$  близко к величине  $(E_c - E_f)_{300 \text{ K}}$  в области  $E_a = (0.4 - 0.45)$  эВ. Для  $E_a < 0.4$  эВ значение  $E_a$  меньше  $(E_c - E_f)_{300 \text{ K}}$ . В то же время в области  $E_a > 0.45$  эВ имеем  $E_a > (E_c - E_f)_{300 \text{ K}}$ . Заметим, что изменение  $E_a$ , происходящее при легировании и освещении, приводит к одинаковому изменению  $(E_c - E_f)_{300 \text{ K}}$ .

Полученные результаты можно объяснить различным характером температурных зависимостей положения уровня Ферми для  $(E_c - E_f) > 0.45$  и  $(E_c - E_f) < 0.4$  эВ. На рис. 2 показано изменение  $(E_c - E_f)$  с температурой для нелегированных и легированных фосфором образцов  $a\text{-Si : H}$ , полученное из-

температурных зависимостей проводимости. Отметим, что проведенные расчеты справедливы для области температур, в которой перенос носителей происходит по делокализованным состояниям ( $T > 150-200$  К [9]). На рис. 2 представлены также данные для одного из легированных образцов после его освещения в течение различного времени. Как видно из рисунка, в области  $(E_c - E_f) < 0.4$  эВ увеличение температуры приводит к смещению положения  $E_f$  к середине щели подвижности  $a\text{-Si : H}$ . В то же время для  $(E_c - E_f) > 0.45$  эВ с ростом температуры положение  $E_f$  смещается к зоне проводимости. Этот результат указывает на существование минимума плотности состояний в щели подвижности в области энергий  $(E_c - E_f) = (0.4-0.45)$  эВ, что согласуется с данными, полученными методом релаксационной спектроскопии глубоких уровней [10]. Аналогичный характер изменения  $(E_c - E_f)$  с температурой для образцов, легированных литием, был представлен в работе [7]. Однако авторы [7] при расчетах использовали значение  $\sigma_0 = 2000 \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ , что привело к смещению полученных ими значений  $(E_c - E_f)$  в область больших энергий. Совпадение данных для  $(E_c - E_f)$ , полученных при изменении  $E_a$  в результате легирования и длительного освещения образца (рис. 1), свидетельствует о том, что освещение не приводит к существенному изменению положения минимума плотности состояний в щели подвижности  $a\text{-Si : H}$ .

Таким образом, проведенные измерения указывают на то, что в нелегированных и легированных донорами пленках  $a\text{-Si : H}$  использование энергии активации температурной зависимости проводимости для определения положения уровня Ферми относительно зоны проводимости приводит к завышенным значениям для  $E_a > 0.45$  эВ и заниженным значениям для  $E_a < 0.4$  эВ.

Автор выражает искреннюю благодарность В. Фусу и Х. Меллу за предложение образцов для исследований и полезные дискуссии.

#### Список литературы

- [1] Stuke J. // J. Non-Cryst. Sol. 1987. V. 97-98. P. 1-14.
- [2] Spear W. E., Steemers H. L., Le Comber P. G., Gilson R. A. // Phil. Mag. B. 1984. V. 50 N 3. P. L33-L40.
- [3] Walloch F., Ley L. // J. Non-Cryst. Sol. 1987. V. 97-98. P. 699-702.
- [4] Vanier P. E. // Solar Cells. 1983. V. 9. N 2. P. 85-93.
- [5] Yoon B.-G., Lee C., Jang J. // J. Appl. Phys. 1986. V. 60. N 2. P. 673-676.
- [6] Beyer W., Overhof H. // J. Non-Cryst. Sol. 1983. V. 59-60. P. 301-304.
- [7] Overhof H., Beyer W. // J. Non-Cryst. Sol. 1980. V. 35-36. P. 375-380.
- [8] Staebler D. L., Wronski C. R. // Appl. Phys. Lett. 1977. V. 31. N 4. P. 292-294.
- [9] Cloude C., Spear W. E., Le Comber P. G., Houd A. C. // Phil. Mag. B. 1986. V. 54. N 4 P. L113-L118.
- [10] Lang D. V., Cohen J. D., Harbison J. P. // Phys. Rev. B. 1982. V. 25. N 8. P. 5285-5320.

Московский  
государственный университет  
им. М. В. Ломоносова

Получено 21.06.1989  
Принято к печати 11.08.1989

*ФТП, том 24, вып. 3, 1990*

#### СПЕКТР ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕКЦИОННЫХ ФОТОДИОДОВ С ВАРИЗОННОЙ БАЗОЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Курмашев Ш. Д., Ирха В. И., Викулин И. М.

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию инжекционных фотодиодов (ИФД) —  $p-i-n$ -структур с длинной базой, работающими в режиме двойной инжеции [1]. Показано, что вид спектральных характеристик фоточувствительности таких диодов может зависеть от интенсивности